

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年4月27日(2006.4.27)

【公表番号】特表2006-503684(P2006-503684A)

【公表日】平成18年2月2日(2006.2.2)

【年通号数】公開・登録公報2006-005

【出願番号】特願2003-576100(P2003-576100)

【国際特許分類】

**B 01 J 19/00 (2006.01)**

**C 01 B 3/16 (2006.01)**

【F I】

B 01 J 19/00 3 2 1

C 01 B 3/16

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月8日(2006.3.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項61

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項61】

入口端および出口端を有し、そして発熱反応触媒を含む反応マイクロチャンバー；  
上記反応マイクロチャンバーと熱接触している少なくとも1つの熱交換マイクロチャン  
ネル；および

上記反応マイクロチャンバーの入口端と熱接触しているヒーター  
を含む示差温度マイクロチャンネル化学加工処理装置であって：

発熱反応性反応体が上記反応マイクロチャンバーを通って流れ、かつ熱交換流体が上記  
の少なくとも1つの熱交換マイクロチャンネルを通って流れているとき、その反応マイク  
ロチャンバーの出口端がその反応マイクロチャンバーの入口端よりも少なくとも約25  
冷たいことが可能である

上記の装置。